

Учебный план*

по программе «Аппаратчик по химической обработке
полупроводниковых материалов»

№ п/п	Наименование модуля	Академических часов
Тема 1	Технология химической обработки исходных материалов, полупродуктов, полупроводниковых материалов и материалов интерметаллических соединений	6ч
Тема 2	Виды и свойства кислот, щелочей, солей и других реактивов и материалов, применяемых для химической обработки, правила обращения с ними и хранения	6ч
Тема 3	Причины брака, меры предупреждения и устранения его	4ч
Тема 4	Технические условия и государственные стандарты на сырье, готовую продукцию, вспомогательные материалы	4ч
Тема 5	Правила работы с высокочистыми материалами	4ч
Тема 6	Технологические карты и рабочие инструкции	4ч
Тема 7	Ведение процесса химической обработки металла, технологической оснастки, кварцевых изделий, тары в кислотах, щелочах и смеси кислот	4ч
Тема 8	Подготовка к травлению и сушка металла и изделий	4ч
Тема 9	Перегонка кислот, подготовка растворов кислот, щелочей и солей требуемой концентрации	4ч
Тема 10	Подготовка, наладка и обслуживание аппаратуры для химической обработки металла, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и сигнализации	4ч
Тема 11	Ведение технической документации	4ч
Тема 12	Постоянное поддержание чистоты на рабочем месте	4ч
Тема 13	Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.	12ч
	Практические занятия	96ч
	ИТОГО:	160ч



Утверждаю

Директор ООО МПЦ «Феникс» _____ Г.В. Котрухов

* Данный учебный план представлен в ознакомительных целях и не является официальным учебным планом, утвержденным и применяемым организацией